

## JY-S100PLUS 离子溅射仪（喷金仪）

品牌：竞赢



JY-S100PLUS 是一款桌上型冷态磁控溅射镀膜系统，标配旋转倾斜样品台，特别适用于各种表面形貌的非导电样品在扫描电镜成像中的高质量镀膜，也可满足电极镀膜，半导体等材料镀膜的要求。

### 主要特性

- 通过新型高效低压直流磁控头进行“超冷”溅射，避免样品表面受损；
- 对于近距离的样品，新型磁控管设计可提供广角覆盖溅射；
- 用于泄气、吹扫和排气的独立电磁阀设计，确保设备的快速运行；
- 喷镀电流控制不受样品室内气压影响，可得到一致的镀膜速率和镀膜效果。
- 可使用多种金属靶材：Pt, Au, Au/Pd, Pt/Pd（Pt 靶为标配），靶材更换快速方便。

### 技术参数

溅射系统	
靶材	Pt 靶为标配，可选 Au，直径 57mm x 0.1mm 厚
标配旋转倾斜样品台	旋转速度：0~60rpm 连续可调，倾斜角度：-45° ~ 45° 连续可调； 不锈钢腔体：直径 120mm X 高 75mm； 观察窗：直径 120mm X 高 45mm； 标配旋转台直径 40mm，可放 4 个标准样品台，其它规格可订做； 具有双重锁紧装置，可确保样品在旋转倾斜时不会松动脱落。
溅射电流	微处理器控制，安全互锁，电流 0~40mA
溅射头	新型低电压磁控管设计，靶材更换快速，环绕暗区护罩
计量表	真空：Atm - $1 \times 10^{-3}$ mbar，电流：0~99mA
控制方法	带有“开始”“暂停”按钮的微处理控制器（1—999s），自动抽气、溅射、关机后自动放气。
真空系统	
抽气速率	133L/MIN
极限真空	$10^{-4}$ mbar 级
噪音	56dB